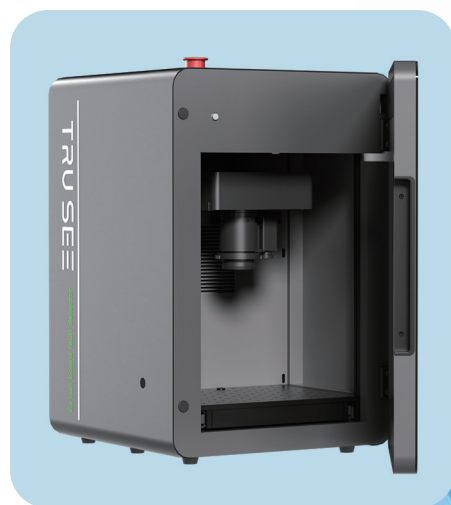
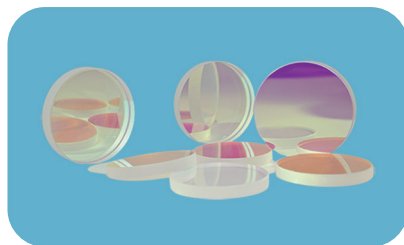
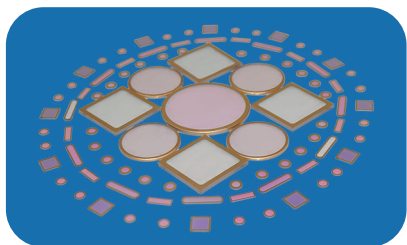
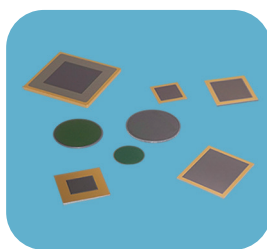
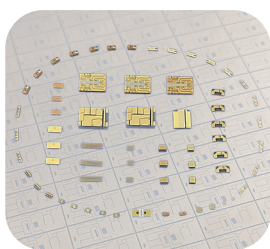
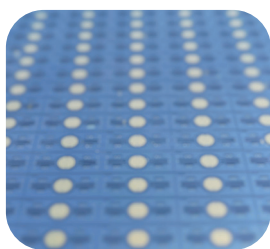


TRUSEE

觉芯电子（无锡）有限公司



公司简介

觉芯电子（无锡）有限公司主要从事光电元器件、光电检测设备、机器视觉设备、光学 MEMS 芯片及模组等产品的研发与制造，可满足科学研究、物联网、先进工业加工、消费电子、5G 通讯、智慧家居自动驾驶等领域的客户需求。

觉芯电子拥有多套高端光学与金属化薄膜真空沉积系统、先进超声清洗平台、高精度图形化制备工艺技术平台、光电检测设备研究与开发平台、MEMS 技术开发平台及其他完善的配套设施。觉芯电子可提供高性能蓝宝石金属化窗口、高损伤阈值激光薄膜器件、高精度金属化陶瓷基板、金锡合金焊料薄膜、特种功能性薄膜、光谱共焦位移传感器、光电检测设备、光学 MEMS 芯片及模组等高性能光电子元器件产品和定制化服务。

觉芯电子拥有一支富有创新精神的精英技术团队。迄今为止，觉芯电子已申请发明专利三十多项，且通过了 ISO9001:2015 质量管理体系认证，拥有完善的研发与生产质量管理控制体系。

行稳致远，开创未来。觉芯电子秉承“为客户创造价值，实现合作共赢”的企业理念，致力于成为光电领域里具备顶级垂直整合能力的领先供应商。

TRUSEE

光谱共焦位移传感器

觉芯电子的全自研 TS-CCS 系列光谱共聚焦位移传感器具有高性能、低成本、大量程等优势,可满足半导体、涂布工业、薄膜片材、运动控制等领域的非接触式位移及形貌检测需求。具有高待测表面适用性与环境稳定性、高重复精度与线性度,且体积小。对透明、高反射、非固态对象检测精度远高于其他检测手段,简单配置即可实现高精度形貌检测。控制器带有丰富接口,量程及状态实时显示,可单通道、一拖二、一拖多探头同步探测。



光学探头	TS-CCS10	TS-CCS02	TS-CCS03	TS-CCS06
量程	10mm	2.5mm	3mm	6mm
工作距离	~ 18.3mm	~ 36mm	~ 7mm	~ 17mm
重复精度 ¹	250nm	80nm	100nm	160nm
重复精度 10 次移动平均 ²	79nm	30nm	43nm	65nm
重复精度 512 次移动平均 ³	13.3nm	4.0nm	5.2nm	8.0nm
线性度	±1.75μm (±0.17‰ F.S)	±0.4μm (±0.17‰ F.S)	±0.5μm (±0.17‰ F.S)	±1.0μm (±0.17‰ F.S)
光斑尺寸	21μm	21μm	21μm	21μm
数值孔径	0.25	0.3	0.3	0.23
最大倾角 ⁴	14.5°	17.5°	17.5°	13.3°

¹ 测量量程中心静止工件时, 输出位移的 1000 次均方根误差 (无信号平均)

² 测量量程中心静止工件时, 经过 10 次移动平均, 输出位移的 1000 次均方根误差

³ 测量量程中心静止工件时, 经过 512 次移动平均, 输出位移的 1000 次均方根误差

⁴ 指镜面全反射材质工件的最大收光角, 一般漫反射工件可达 80°

光谱共焦位移传感器

◆ 非接触 3D 形貌扫描解决方案

觉芯电子提供非接触式高精度位移传感及形貌检测方案，基于全自研光谱共聚焦位移传感器 TS-CCS 系列。TS-CCS 系列光谱共焦位移传感器对待测对象表面要求低，能准确地对粗糙、湿润、倾斜的各种表面进行非接触式形貌探测。探头安装要求低、体积小，结合位移机构可用于各种对象的表面 3D 形貌探测。可用于涂布、印刷电路、光学表面形貌探测等多种应用场景。



适用性高，高反射、粗糙、未固化的各种表面均可稳定测量



探头不受电磁干扰、恶劣环境影响，稳定性高



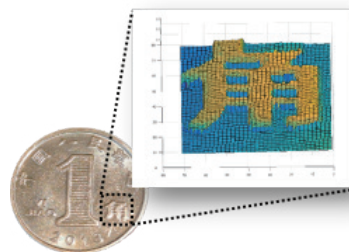
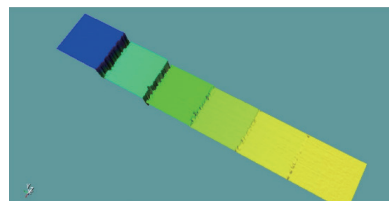
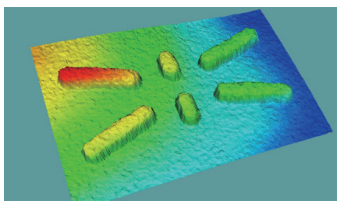
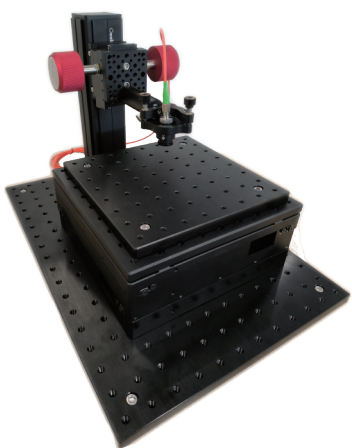
移动平均下重复精度 < 10nm



探头体积小，同轴测量不易被遮挡，适用于空间有限场景



非接触式同轴测量，避免对待测对象的损伤，使用寿命长



传动机构联动实现 3D 形貌扫描





觉芯电子(无锡)有限公司

地址：江苏省无锡市新吴区汉江路 15 号环普旺庄国际产业园
B 区 28 号厂房一楼

电话：0510-81190332-8002/8006/8013/8014

邮箱：sales@trusee.com

网址：www.trusee.com

